

財團法人國家實驗研究院 公告

發文日期：中華民國115年6月4日
發文字號：國研授半導體微字第1151300750號
附件：

主旨：本院台灣半導體研究中心CF-L28可變形束電子束光罩製作曝光機年度保養停機公告

公告事項：

- 一、停機設備：CF-L28可變形束電子束光罩製作曝光機 (Variable Shaped Beam Mask Writer)。
- 二、停機原由：例行預防性保養及消耗性零件更換。
- 三、停機時程：自115年8月3日至8月14日止。
- 四、聯絡窗口：分機7647，陳先生。
- 五、若有任何異動，如機台因故須提前保養，將於MES系統狀態更新，不再另行公告。

院長 蔡長策

授權單位主管決行